

Реєстраційна картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0115U003173

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 20-02-2015

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201020

У тому числі по роках:	
2015	250 тис. грн.
2016	500 тис. грн.
2017	500 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування: 1500 тис. грн.	

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442878922, 0442878922

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна металургійна академія України

Код за ЄДРПОУ: 02070766

Місцезнаходження: проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380567454196, 380563748210

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Вплив комплексної фізико-хімічної обробки у рідкому та твердому станах на структуроутворення та властивості напівпровідникового кремнію

Назва роботи англійською:

The influence of complex physic-chemical processing at the liquid and solid states on formation of structure and properties of semiconductor silicon

Мета роботи українською:

Метою даної роботи є встановлення впливу комплексного фізико-хімічного впливу у рідкому (легування, обробка в магнітному полі) та твердому (магнітний вплив, термічна обробка) станах на структуроутворення та властивості напівпровідникового кремнію. Основними завданнями проекту є розробка в Україні та промислове випробування комплексної ресурсо- та енергозберігаючої технології виробництва напівпровідникового кремнію з високими показниками електрофізичних та механічних властивостей за рахунок фізико-хімічного впливу у рідкому та твердому станах для розширення галузей його використання (високі показники електрофізичних властивостей для оптичної та електронної промисловості та мікротвердості структурних складових для біомедичного застосування).

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Інше

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Технології

Галузь застосування: Матеріали електронної техніки та біомедичного застосування

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Куцова Валентина Зиновіївна

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Вплив комплексної фізико-хімічної обробки у рідкому та твердому станах на структуроутворення та властивості напівпровідникового кремнію

Початок етапу: 01.2015

Закінчення етапу: 12.2017

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 669.017.3; 669.017.3:620.18, 669.017.113:669.13

Коди тематичних рубрик: 53.49.03

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Пройдак Юрій Сергійович
д. т. н., 05.16.04

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

Юрченко Т.А.

